

**Interreg**



Kofinanziert von  
der Europäischen Union  
Spolufinancováno  
Evropskou unií

Sachsen – Tschechien | Česko – Sasko

**Interreg Sachsen – Tschechien  
2021-2027**

**Interreg Česko – Sasko  
2021–2027**



# SUPPORT4SME

## Přeshraniční podpora zapojení malých a středních podniků do materiálového výzkumu budoucnosti

### Grenzüberschreitende Unterstützung für die Beteiligung von KMU an der zukünftigen Materialforschung

Hlavní cíl projektu

Hauptziel des Projekts

***Rozvoj a řešení společných výzkumných témat a poskytování služeb aplikovaného výzkumu***

***Entwicklung und Bearbeitung gemeinsamer Forschungsthemen und Bereitstellung von wissenschaftlichen Dienstleistungen.***

Celkové náklady projektu

Gesamtkosten des Projektes

3.052.522,28 Eur

**Leadpartner:** Technická univerzita v Liberci

**Partner projektu:** Technische Universität Chemnitz



# SUPPORT4SME

**vytváří mezioborovou síť expertů, kteří podpoří a implementují inovace do malých a středních podniků**

**schafft ein interdisziplinäres Netzwerk von Experten zur Unterstützung und Umsetzung von Innovationen in KMU**

## Naše služby

- **Environmentální a toxikologické analýzy**
- **Fyzikálně-chemické, mechanické a technologické analýzy materiálů**
- **Vývojové aktivity**
- **Předávání odborných zkušeností do průmyslové sféry**

## Unsere Dienstleistungen

- **Umwelt- und toxikologische Analysen**
- **Physikalisch-chemische, mechanische und technologische Analysen von Materialien**
- **Entwicklungstätigkeiten**
- **Transfer von Fachwissen an die Industrie**



# FIB-SEM dual-beam elektronový mikroskop s plasmovým fokusovaným svazkem

## FIB-SEM Zweistrahl-Elektronenmikroskop mit fokussiertem Plasmastrahl



### Základní parametry mikroskopu:

- Xe+ plasma FIB
- Mikromanipulátor
- Hlavní detektory:
  - ✓ Detektor sekundárních elektronů SE
  - ✓ Detektor zpětně odražených elektronů BSE
  - ✓ Detektor umožňující detekci sekundárních iontů emitovaných v průběhu procesu FIBování
  - ✓ Detektor STEM
  - ✓ Mikroanalýza EDS + EBSD

### Grundlegende Mikroskop-Parameter

- Xe+-Plasma FIB
- Mikromanipulation
- Hauptdetektoren:
  - ✓ Sekundärelektronendetektor
  - ✓ BSE Detektor für rückgestreute Elektronen
  - ✓ Detektor zum Nachweis der während des FIB-Prozesses emittierten Sekundärelektronen
  - ✓ STEM Detektor
  - ✓ Mikroanalytik EDS + EBSD

## Příklady široké použitelnosti zařízení Beispiele für die breite Anwendbarkeit der Geräte

Možnost realizace přesných bezdeformačních řezů

Möglichkeit von präzisen, deformationsfreien Schnitten

